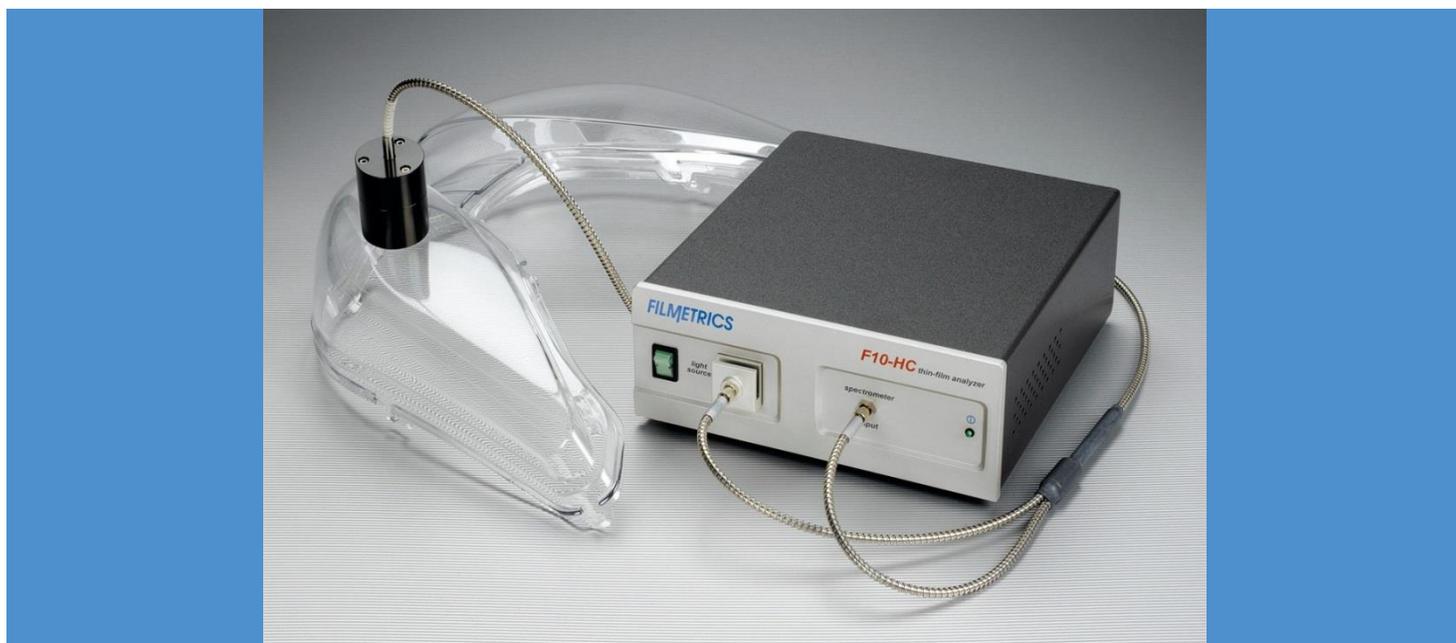


# F10-HC

## 薄膜厚度测量仪



### 最具有价格优势的先进薄膜测量系统

以 F20 平台为基础所发展的 F10-HC 薄膜测量系统，能够快速分析薄膜的反射光谱资料并提供测量厚度，加上 F10-HC 软件特有的先进模拟演算算法的专利设计，能够在厚膜中测量单层与多层（例如：底漆或硬涂层等）。

### 前所未见的简易操作界面

现在，具有新样板模式功能的 F10-HC 将更容易使用，这个功能允许使用者汇入样品的影像（请参考下页），并直接在影像上定义测量位置。系统会自动通知使用者本次测量结果是否有效，并将测量的结果显示在汇入的影像上让使用者分析。

### 不需要手动基准校正

F10-HC 现在能执行自动化基准校正以及设置自己的积分时间，这个创新的方法不需要频繁的执行基准校正就可以让使用者立即的执行样品的测量。通过自动设置积分时间完成自动校正，这项发明可以让使用者立即的执行样品的测量而不再需要频繁的执行校正程序。

### 背面反射干扰

背面反射干扰对厚度测量而言是一个光学技术的挑战，具有 F10-HC 系统的独特接触式探头能将背面反射干扰的影响最小化，使用者能以较高的精准度来测量涂层厚度。

### Filmetrics 优势

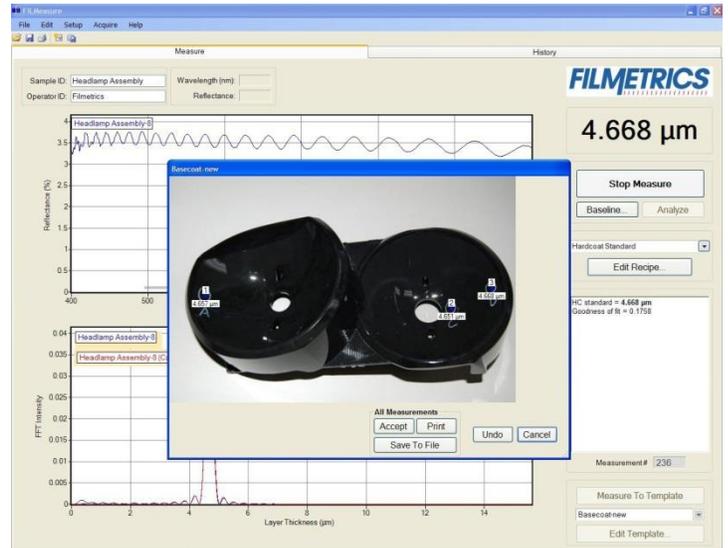
- 嵌入式在线诊断
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测量结果

### 免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！

# F10-HC

## 薄膜厚度测量仪



使用者能够在操作系统时导入样本的影响并定义测量位置。

厚度	
测量范围:	0.05-70 微米
准确度*:	0.4% 或 0.01 微米之间较大
精度*:	0.001 微米
稳定性*:	0.001 微米
光谱仪	
波长范围:	380-1050 纳米

\*光谱匹配模式，取决于材料

基本要求	
斑点尺寸:	200 微米
光源:	钨卤素灯
电源要求:	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0.3-0.1 A
电脑要求	
处理器速度:	大于 1 GHz
接口:	USB 2.0
操作系统	
PC:	Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)
Mac:	OS X Lion/Mountain Lion



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改，恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc